

多点監視用パーティクルセンサ KA-82

0.1 μm 。リアルタイムモニタリング用センサ

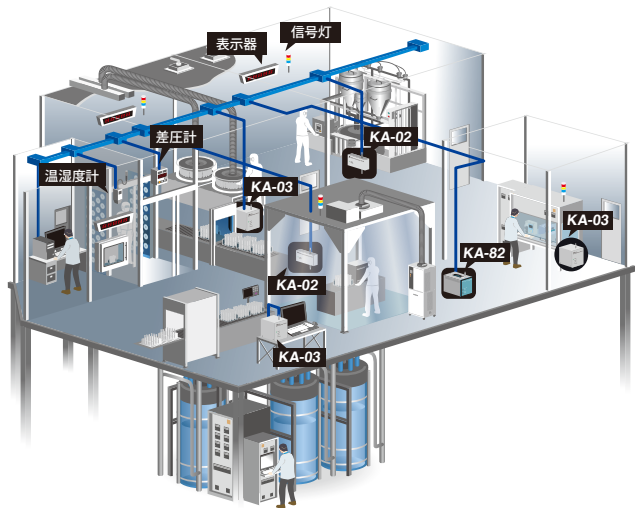


- クリーンルームの常時・同時多点モニタリングが可能
- モニタリングポイントの設置・変更、レイアウト変更に対応
- ポンプ内蔵型。各測定点に直接設置が可能
- 多点モニタリングシステムに対応 (RPモニタ Evo10 K1701 Ver. 3で160ポイント)

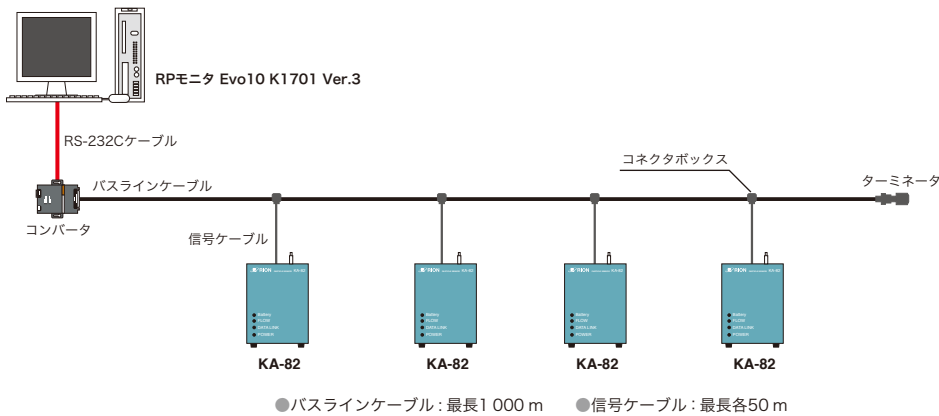
仕様

光学方式	側方散乱方式
光源	半導体レーザー励起固体レーザー（波長：1 064 nm）オープンキャビティ型 半導体レーザー（波長：800 nm、定格出力：1 W） 固体レーザー（Nd：YVO4）
レーザー製品のクラス	クラス1、IEC 60825-1
受光素子	フォトダイオード
定格流量	2.83 L/min
最小可測粒径	0.1 μm（屈折率1.6の球形粒子の時）
粒径区分（5段階）	0.1 μm以上、0.15 μm以上、0.2 μm以上、0.3 μm以上、0.5 μm以上
最大粒子個数濃度	10 000個/L（計数損失5 %以内）
入出力端子	
ALARM 1端子／ ALARM 2端子	アラーム出力用端子（接点最大負荷 DC30 V、1 A） DATA LINK端子を介してアラーム出力の指示を受けると端子間が リレー接点により短絡
DATA LINK端子	多点システム用インターフェース
電源	AC100 V～240 V、50/60 Hz、約100 VA
大きさ・重さ	185(H)×155(W)×330(D)mm（突起部を除く）・約7.5 kg
付属品	サンプリング管×1 サンプリングチューブ（2 m）×1 電源コード（日本国内にてAC100 Vで使用可能、2.5 m）×1

センサ多点モニタリングシステム 構成例



センサ多点モニタリングシステム 接続例（RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3の場合）

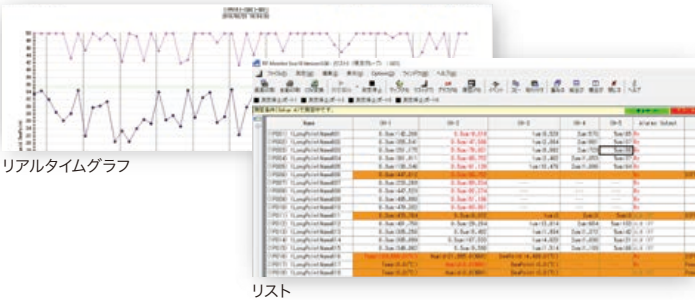


RPモニタ Evo10 K1701 Ver.3

オプション



- パーティクルカウンタの制御、自動運転、データ収集、表示、ファイリング、印字が行えます。
- シリアルモードのパーティクルカウンタと、MultiモードRのパーティクルカウンタを最大32台（拡張160台接続）まで同時に制御可能
- 対応OS:Microsoft Windows 10 Pro 64 bit



<https://www.rion.co.jp/>

*本カタログ掲載の会社名、商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
*本カタログ掲載の各製品のデザイン・仕様などは予告なく変更する場合があります。

本社 微粒子計測器営業部

〒185-8533 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号
TEL(042)359-7878 FAX(042)359-7458

九州リオン(株)

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町5番18号
TEL(092)281-5366 FAX(092)291-2847

修理に関するお問い合わせ

リオンサービスセンター(株)

〒192-0918 東京都八王子市兵衛2丁目22番2号
TEL(042)632-1160 FAX(042)632-1140

